

| อัตราค่าบริการ Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) | | ค่าใช้จ่าย (บาท) * |
|--|-------------|--------------------|
| 1. ค่าบริการ ถ่ายภาพ ในโหมด SEI, BEI หรือ TEI | ชั่วโมงละ | 1,500 |
| 2. ค่าบริการ วิเคราะห์ธาตุด้วย EDS | ชั่วโมงละ | 1,500 |
| 2.1 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ | /จุด/sample | 400 |
| 2.2 วิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบไม่ใช้สาร มาตรฐาน | /จุด/sample | 500 |
| 2.3 วิเคราะห์ด้วย mapping และ line scan | /ธาตุ | 200 |
| หมายเหตุ ค่าบริการ 2.1 - 2.3 คิดเพิ่มจากค่าบริการรายชั่วโมง | | |
| 3. ค่าบริการถ่ายภาพ ในโหมดการเลี้ยวเบน (EBSD) | ชั่วโมงละ | 1,500 |
| 3.1 ทำ mapping | /ภาพ | 500 |
| หมายเหตุ ค่าบริการ 3.1 คิดเพิ่มจากค่าบริการรายชั่วโมง | | |
| 4. ค่าบริการทำลวดลายด้วย Electron Beam Lithography | ชั่วโมงละ | 1,500 |
| 4.1 ออกแบบลวดลาย | /layer | 2,000 |
| 4.2 แปลงไฟล์ลวดลาย | /layer | 500 |
| 4.3 เตรียม/สปิน e-beam resist | /layer | 500 |
| 4.4 e-beam developer | /layer | 500 |
| หมายเหตุ ค่าบริการ 4.1 – 4.4 คิดเพิ่มจากค่าบริการรายชั่วโมง | | |
| 5. ค่าบริการเตรียมตัวอย่างด้วยเครื่อง Ion-Milling | ชั่วโมงละ | 1,500 |
| 5.1 เตรียมอุปกรณ์จับชิ้นงาน | /sample | 1,000 |
| 5.2 ตัดชิ้นงานด้วย diamond saw | /sample | 200 |

***หมายเหตุ**

1. ค่าบริการในอัตราที่ระบุไว้เป็นอัตราเฉพาะ ห้องปฏิบัติการภายใน ThEP Center และหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ
2. สำหรับหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ จะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นอีก 30% จากอัตราที่ระบุไว้
3. กรณีที่มีความต้องการใช้บริการเร่งด่วน จะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้น 2 เท่า